2 探針走査型近接場光学顕微鏡の構築

Construction of dual-probe scanning near-field optical microscopy (DSNOM)

正木 雄太 (M1), 小島 康裕(B4)

Yuta Masaki, Yasuhiro Kojima

Abstract

We construct dual-probe scanning near-field optical microscopy (DSNOM), where near-field light is excited and detected at different position by different fiber probes. DSNOM provides a powerful tool to visualize propagating SPP or scattering electrons under diffraction limit of light, which conventional optical microscopy cannot do. Moreover, combination with femtosecond laser pulses and DSNOM will make it possible to measure ultrafast physical phenomena in nanometer scale. However, approaching two fiber probes within several tens of nanometer is challenges till now. We report here that we can scan the detection fiber probe around the excitation fiber probe without physical contacts between them, using dual-band modulation (DBM) techniques. We confirm that these two fiber probes approaches by the distance of from 50 to 100 nm

1. はじめに

情報化社会の発展に伴って,光デバイスの大容量 化・微細化が求められてきているが,従来の光学で は光を回折限界以下に閉じ込めることができない. そこで,物質界面上に存在する近接場光を用いたナ ノフォトニクスが昨今注目されてきている.特に, 金属ナノ粒子に光を照射することで生じる局在プ ラズモン共鳴は,光エネルギーをナノメートルスケ ールの空間へ閉じ込め,尚且つ共鳴現象により強い 電場を誘起することができる.更に,この局在プラ ズモン共鳴はフェムト秒スケールの時間応答を有 するために、フェムト秒レーザを励起源とすること で、超微小な空間に超高速な電場を生成することが できる.

一方で,プラズモン場はナノ粒子の半径と同程度の 空間に局在し、非伝搬である.したがって、このプ ラズモン場の応答を知るためには、同程度の大きさ のナノ粒子を近づけプラズモン場を散乱光へ変換 する必要がある.この原理を利用したものに、走査 型近接場光学顕微鏡(SNOM: Scanning Near-field Optical Microscopy) がある. SNOM は先端径が約 100 nm であるファイバプローブをサンプルに数十 nm まで近づけることで物質界面上の近接場光を 励起,または検出している.このために,回折限界 以下の空間分解能を有する. SNOM はその目的に 応じて3つのオペレーションモードがある. Fig. 1 に3つのモードを示した.ファイバプローブによっ て近接場光を励起又は検出するのが Illumination mode と Collection mode である. 一方で, 励起も検 出も同一のファイバプローブで行うのが Illumination-collection mode である. しかし, 前者2 つのモードでは、励起と検出のどちらか一方の空間 分解能を犠牲にしている.後者のモードでは励と検 出の双方の空間分解能が高いが、ファイバプローブ の開口外へ伝播していく表面プラズモンやキャリ アの観測を行うことができない. これらの問題を解 決し,回折限界以下の空間領域における物理的現象 の観測を行うためには、励起用と検出用に2本のフ ァイバプローブを用いた新たな SNOM モードの確 立が欠かせない. 更に, フェムト秒レーザと組み合 わせることによって時間分解測定も可能となる.こ

のような背景から,今回我々は2探針走査型近接場 光学顕微鏡,即ち Dual-probe SNOM (DSNOM)の作 製を行った.具体的には,2つ目の原子間力顕微鏡 (AFM)システムを構築し,検出用プローブが励起用 プローブの周りを物理的接触なしにラスタースキ ャンできるようなシステムの実証を行った.





2. 原子間力顕微鏡(AFM)の構築

A.AFM システム

我々は既にシアフォースモード AFM システム を1台構築しているために[1],基本的にそれと同 じシステムを構築した.大きく異なるのは、ピエ ゾステージがプローブ側に備え付けられており, プローブ先端位置の微動制御を行っている点であ る. Fig.2 にシステムのダイアグラムを示す. ロッ クインアンプで内部発振した電圧信号をチューニ ングフォーク(TF)に与えることで、ピエゾ効果に より TF が電圧信号と同じ周波数で機械的振動を する. ここで, 電圧信号の周波数は TF の共鳴周 波数(=32 kHz)に合わせている. そうすると, TF の機械的振動の振幅に比例した大きさの電流が流 れるので、それを電圧変換かつアンプした信号を ロックイン検出する. TF に接着したファイバプロ ーブがサンプルに近接すると、シアフォースによ って TF の振動振幅値, すなわちロックイン検出

値が小さくなるので、ロックイン検出信号を用い てフィードバック制御システムを構築すれば、フ ァイバプローブ・サンプル表面間の距離を一定に 保つことができる.我々は、PID コントローラに ロックイン検出信号を入力し、その出力値をピエ ゾステージのドライバに入力することで、PID 制 御システムを構築した.ここで、PID コントロー ラの目標値入力には DAQ からの出力電圧を用い ているために、LabVIEW を操作することで目標値 を変動できる.また、ピエゾステージの x, y 軸方 向の位置制御も LabVIEW によって直接制御でき るようにした.





B. Tip Approach

今回我々が用いているピエゾステージの3軸方 向のストロークは36 µm である.これはSNOM に 備え付けられた CCD カメラの空間分解能よりも十 分に大きいので, ピエゾステージをこのストローク 分動かすことで CCD カメラのイメージ上の絶対的 な距離が分かる.したがって, それを基に同じ CCD カメラの暗視野イメージからファイバプローブ先 端とサンプル表面の距離が大まかに分かる.ピコモ ータによってファイバプローブ先端とサンプル表 面の距離をピエゾステージのストローク内まで近 づけた後に,目標値を下げて Tip Approach を行うこ とで,短時間でフィードバックを掛けることができ る.

C. Topography 測定

AFM システムの機能性を検証するために,Si 製 グレーティングをサンプルとしてトポグラフィ測 定を行った.このグレーティングの周期は3・m, 高さは112 nm である.測定条件は、スキャン方向 をグレーティングの周期方向、分解能を25 nm,ス キャン速度を1 s/plot とした.測定結果を Fig.3 に 示す.(a)はトポグラフィ,(b)は1 軸マッピングを 示す.このように、グレーティングの周期に沿った 形状を測定することができ、またグレーティングの 形状を表す縞が縦方向に綺麗に並んでおり、AFM の機能を実証することができた.ただし、1 軸マッ ピング結果を見ると高さが 80 nm 程度となってお り足りていない.この原因が AFM システムにある のかどうかは現在検討中である.



Fig. 3 Measurement results of (a) topography and (b) 1 line mapping.

3. Dual-Band Modulation(DBM)システム

の構築

A. DBM システムの構築

Fig. 4(a)に今回構築した DSNOM の正面図を示 す. ここで, I probe を励起用プローブ, C probe を 検出用プローブとする. I probe を AFM 探針とし て用いる時にはサンプル下のピエゾステージが微 小動作し,一方で C probe を AFM 探針として用い る時には C probe に備え付けられたピエゾステー ジが微小動作するようになっている. ここで, I probe と C probe がそれぞれ異なる距離制御システ ムによってサンプル表面と一定の距離を保ってい る. I probe の位置は常に固定された状態であり、 C probe は I probe の周りをラスタースキャンす る. この時、プローブ間の距離が最大数十 nm に なるまで近接させる一方で、プローブ先端は壊れ やすいので物理的接触してはならない. つまり, I probe, C probe, サンプルの3者が同時に近接しな がら、どれもが物理的接触しないようなシステム の構築が必要である. このようなシステムとして DBM テクニックがある[2]. Fig. 4(b)に示したよう に, DBM テクニックでは 32 kHz と直交した方向

(=2 つのプローブが並んでいる方向) に 75 Hz の振動をピエゾステージによって与える. このこ とによって, 2 つのプローブ間にシアフォースが 働くほど 2 つのプローブが近づいた時にのみ 32 kHz のロックイン検出信号に 75 Hz の変調信号が 載る. なので, この信号を更に 75 Hz でロックイ ン検出し, その信号変化を測定することで 2 つの プローブが近接したことを検出することができ る. 実際に構築したシステムでは, I probe と C probe の両方で 75 Hz ロックイン検出を行ってお り, それらを DAQ で PC に取り込んだ後に LabVIEW プログラム上で掛け合わせることで, S/N 比を改善している. ピエゾステージを 75 Hz 振動させるための電圧信号や 75Hz ロックイン検 出に用いる参照信号は全て DAQ から出力したも のを用いている.



Fig. 4 Schematic image of (a) DSNOM and (b) I probe and C probe.

B.DBM システムの実証

DBM システムを用いることで物理的接触なしに C probe が I probe の周りをラスタースキャンする ことができるのか実証実験した. Fig. 5 にその概念 図を示す. C probe を-y 方向にスキャンさせると, ある地点において I probe と近接する. 近接した時 にのみ DBM システムで取り込んだ信号値が大き くなるので、その信号値が事前に設定した閾値を 超えた地点で C probe のスキャンを停止し,開始 地点に戻す. これを+x 方向に位置をずらして反復 して行うことで、トポグラフィ測定を行うことが できる. 測定したトポグラフィ結果とそれに対応 した信号値変化を Fig. 5(b)と(c)に示す. これらの 測定結果から2つのプローブが近接した地点での み信号値が大きくなり、C probe のスキャンが停止 していることが分かる.この信号値が大きく変化 している地点における TF の振動振幅値を測定す ることで, I probe と C probe が物理的に接触して いないことも確認できた. このことから DBM シ ステムを構築できたということができる.ただ し、トポグラフィ画像における I probe の像が予期 していたものよりも大きく,2つのプローブの先 端で近接しているのかどうか今後確認する必要が ある.







(c)

Fig. 5 (a) Schematic image of how to scan C probe around I probe and measurement results of (b) topography and (c) signal mapping.

4. まとめ

2台目の AFM を構築し, DBM システムを用い ることで,2探針走査型近接場光学顕微鏡を構築す ることができた. DBM システムの構築にあたって は,LabVIEW を用いたソフトウェア処理とハード ウェア処理を併用した.今後の課題としては,2つ のプローブの先端が近接できているか確認するこ と,DBM システムにおける信号変化をより大きく することでシステムの安定性を向上すること等が 挙げられる.

References

- [1] 松石圭一郎: 近接場光学顕微鏡を用いた金属
 ナノ構造局在プラズモン場の超高速応答関
 数計測 慶應義塾大学修士論文(2011).
- [2] A. Kaneta, R. Fujimoto, T. Hashimoto, K. Nishimura and M. Funato, "Instrumentation for dual-probe scanning near-field optical microscopy," Rev. Sci. Instrum. 83, 083709 (2012).